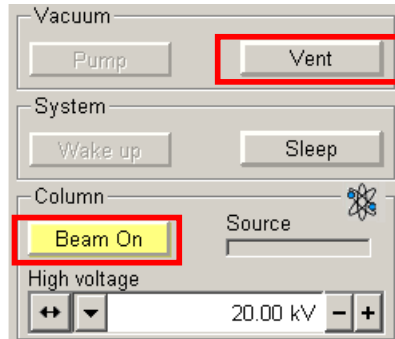


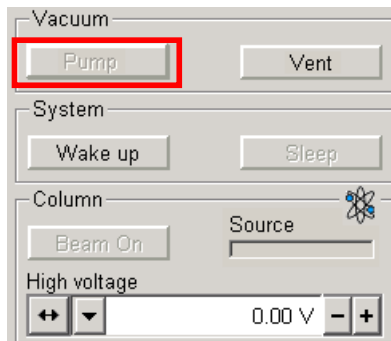
NOVA 600 操作流程

1) 試片的置放

程序:a) i)關閉 E beam/I beam, ii)按 Vent



b) i)拉開 chamber door 並置入樣品, ii)按 Pump

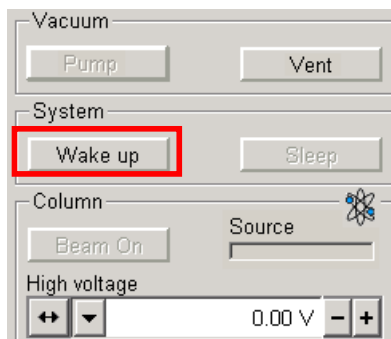


c) 確認真空度達約 10^{-5} mbar



2) 電子束及離子束的 ON/OFF

程序:按 Wake up 以開啟 E beam/I beam



3) 試片/切割點的搜尋

程序:a) 以低倍率 SEM(mode 1) 聚焦並搜尋樣品

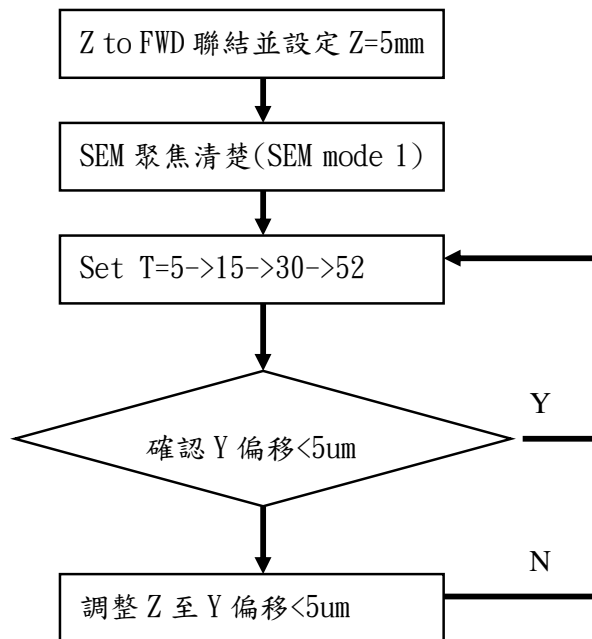
b) i) 執行 Z to FWD 的聯結, ii) 設定 Z=5mm (在 SEM mode)



c) 將倍率調至約 5000x (scal bar 顯示 5um), 並調聚焦 (注意: stage 的移動必需配合滑鼠和 QUADE 1-3 in CCD camera screen)

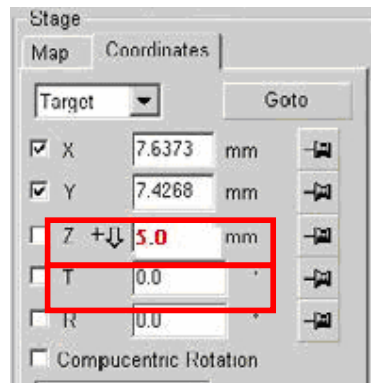
4) 試片共焦點 (Eucentric height) 的設定 (在 SEM mode)

程序:



注意:i) Z 軸的移動必需配合滑鼠和 QUADE 4 in CCD camera screen

ii) 5 軸座標參數設定



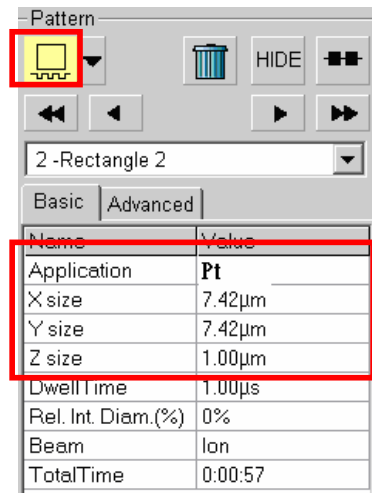
5) 試片的切割及鍍 Pt 保護層

程序: a) 切換至 FIB mode (beam current 選定 30~50pA)

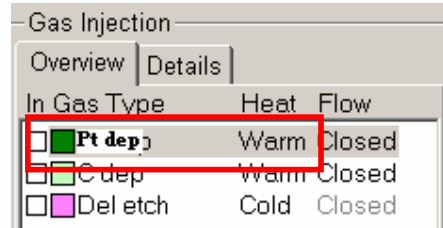
b) 選 patterning



c) i) 選定 patterns, 設定 xyz, ii) 選定 material file, iii) 選定適當的 I beam currents.



d) 加熱 Pt 及伸針

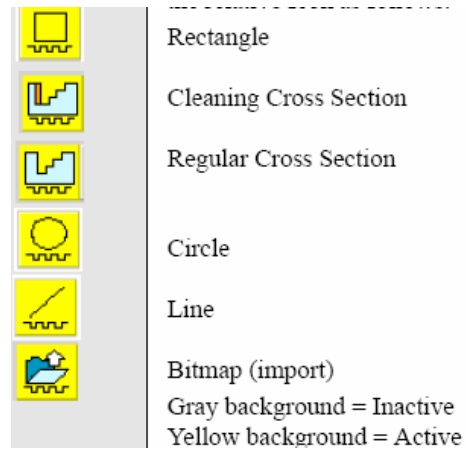


e) 執行 patterning



c) 執行 X-section

選定 regular cross section -> cleaning cross section



6) 取影像及儲存影像(切換至 SEM mode)



即時影像



取單張影像

F2 為 photo